

HiCube Neo RGA

残余气体分析系统



安全

集成 DigiLine 全量程变送器，用于监测总压并保护灯丝

灵活

便携式，配件范围广泛，例如不同质量范围、腔体加热、运输箱

结构紧凑

集成涡轮分子真空泵机组和质谱仪

配件

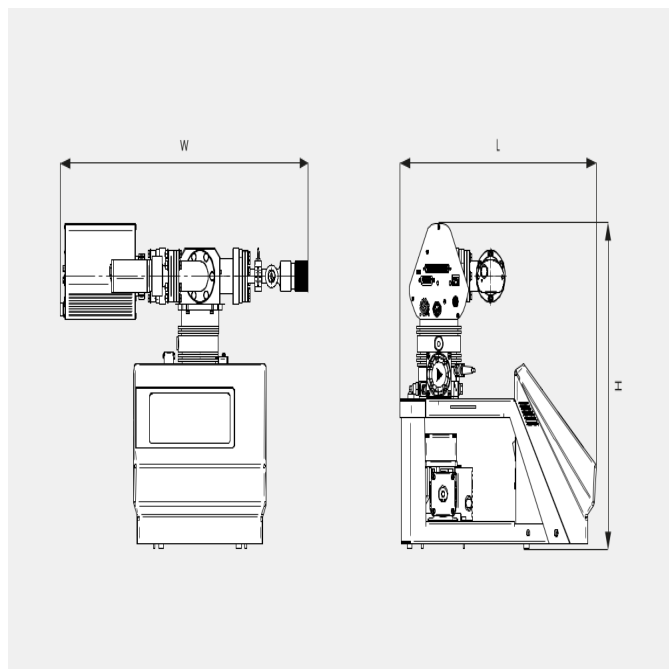
- 备用电子器件
- 备用离子源
- 备用灯丝
- 备用分析仪
- 备用真空计
- 备用真空泵或真空泵维修套件
- 备用进气阀
- 质量范围
- 灯丝材料
- 各种前级泵
- 各种真空计
- 腔体加热
- 配备 Pfeiffer MassSpec 软件的计算机
- 截止阀
- 校准气体选配
- 运输箱
- 移动推车

HiCube Neo RGA

残余气体分析系统



尺寸图



抽速

以下技术值是指 ISO Hz

	HiCube Neo RGA (QMG 250 F1)	HiCube Neo RGA (QMG 250 F2)	HiCube Neo RGA (QMG 250 F3)
重量范围	1 - 100 u	1 - 200 u	1 - 300 u
检测极限	$4 \cdot 10^{-13}$ hPa (mbar)	$5 \cdot 10^{-13}$ hPa (mbar)	$7 \cdot 10^{-13}$ hPa (mbar)
空气灵敏度	$5 \cdot 10^{-4}$ A/hPa (mbar)	$4 \cdot 10^{-4}$ A/hPa (mbar)	$3 \cdot 10^{-4}$ A/hPa (mbar)
最大工作压力	$5 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$5 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$5 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)
杆系统	直径 6 mm, 长度 125 mm	直径 6 mm, 长度 125 mm	直径 6 mm, 长度 125 mm
分析仪操作温度	200 °C	200 °C	200 °C
电子元件操作温度	5 - 50 °C	5 - 50 °C	5 - 50 °C
烘烤温度	300 °C (已移除电子元件)	300 °C (已移除电子元件)	300 °C (已移除电子元件)
尺寸 (L x W x H)	446 x 583 x 434 mm	446 x 583 x 434 mm	446 x 583 x 434 mm
连接法兰	DN 16 ISO-KF / DN 40 CF-F	DN 16 ISO-KF / DN 40 CF-F	DN 16 ISO-KF / DN 40 CF-F
检漏仪	法拉第	法拉第	法拉第
对相邻质量的影响	< 10 ppm	< 20 ppm	< 50 ppm

HiCube Neo RGA

残余气体分析系统



	HiCube Neo RGA (QMG 250 F1)	HiCube Neo RGA (QMG 250 F2)	HiCube Neo RGA (QMG 250 F3)
10% 峰高时的分辨率	0.5 - 2.5 u	0.5 - 2.5 u	0.5 - 2.5 u
停留时间	1 ms - 16 s/u	1 ms - 16 s/u	1 ms - 16 s/u
重量 (约)	22 - 27 kg	22 - 27 kg	22 - 27 kg
电源电压	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
接口	以太网	以太网	以太网
峰高比的重现性	± 0.5 %	± 0.5 %	± 0.5 %
功耗	最大值 240 W, 不加热, 最大 400 W, 带加热装置	最大值 240 W, 不加热, 最大 400 W, 带加热装置	最大值 240 W, 不加热, 最大 400 W, 带加热装置

以下技术值是指 ISO Hz

	HiCube Neo RGA (QMG 250 M1)	HiCube Neo RGA (QMG 250 M2)	HiCube Neo RGA (QMG 250 M3)
重量范围	1 - 100 u	1 - 200 u	1 - 300 u
检测极限	$4 \cdot 10^{-13} / 3 \cdot 10^{-1\#}$ hPa (mbar)	$5 \cdot 10^{-13} / 4 \cdot 10^{-1\#}$ hPa (mbar)	$7 \cdot 10^{-13} / 5 \cdot 10^{-1\#}$ hPa (mbar)
空气灵敏度	$5 \cdot 10^{-4}$ A/hPa (mbar)	$4 \cdot 10^{-4}$ A/hPa (mbar)	$3 \cdot 10^{-4}$ A/hPa (mbar)
最大工作压力	$5 \cdot 10^{-4} / 5 \cdot 10^{-\#}$ hPa (mbar)	$5 \cdot 10^{-4} / 5 \cdot 10^{-\#}$ hPa (mbar)	$5 \cdot 10^{-4} / 5 \cdot 10^{-\#}$ hPa (mbar)
杆系统	直径 6 mm, 长度 125 mm	直径 6 mm, 长度 125 mm	直径 6 mm, 长度 125 mm
分析仪操作温度	200 °C (使用 SEM 时最高 150°C) °C	200 °C (使用 SEM 时最高 150°C) °C	200 °C (使用 SEM 时最高 150°C) °C
电子元件操作温度	5 - 50 °C	5 - 50 °C	5 - 50 °C
烘烤温度	300 °C (已移除电子元件)	300 °C (已移除电子元件)	300 °C (已移除电子元件)
尺寸 (L x W x H)	446 x 583 x 434 mm	446 x 583 x 434 mm	446 x 583 x 434 mm
连接法兰	DN 16 ISO-KF / DN 40 CF-F	DN 16 ISO-KF / DN 40 CF-F	DN 16 ISO-KF / DN 40 CF-F
检漏仪	C-SEM, 法拉第	C-SEM, 法拉第	C-SEM, 法拉第
对相邻质量的影响	< 10 ppm	< 20 ppm	< 50 ppm
10% 峰高时的分辨率	0.5 - 2.5 u	0.5 - 2.5 u	0.5 - 2.5 u
停留时间	1 ms - 16 s/u	1 ms - 16 s/u	1 ms - 16 s/u
重量 (约)	22 - 27 kg	22 - 27 kg	22 - 27 kg

HiCube Neo RGA

残余气体分析系统



	HiCube Neo RGA (QMG 250 M1)	HiCube Neo RGA (QMG 250 M2)	HiCube Neo RGA (QMG 250 M3)
电源电压	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
接口	以太网	以太网	以太网
峰高比的重现性	± 0.5 %	± 0.5 %	± 0.5 %
功耗	最大值 240 W, 不加热, 最大 400 W, 带加热装置	最大值 240 W, 不加热, 最大 400 W, 带加热装置	最大值 240 W, 不加热, 最大 400 W, 带加热装置